

G21K 他に分類されない粒子線または電離放射線の取扱い技術；照射装置；ガンマ線またはX線顕微鏡 [2]

注

このサブクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用いる：

- 「粒子」は、分子、原子または原子以下の大きさの粒子を意味する。[2012.01]

- 1/00 粒子または電離放射線の取扱い装置、例
・集束または減速（電離放射線フィルタ - G21K3/00；中性子、荷電粒子、中性分子ビ - ムまたは中性原子ビ - ムの発生または加速 H05H3/00 から H05H15/00）[2]
- E 電子線の発生、取扱い（照射装置は G21K5/04）
- A 原子線、イオン線の発生、取扱い（照射装置は G21K5/04）
- X X線の取扱い（照射装置は G21K5/02、発生用タ - ゲットの保持具は G21K5/08）
- N 中性子の取扱い（照射装置は G21K5/02、発生用タ - ゲットの保持具は G21K5/08）
- R RIの取扱い（照射装置は G21K5/02）
- Z その他のもの
- 1/02 ・絞り、コリメ - タ - を用いるもの [2]
- R 照射範囲を限定するためのもの、例、絞りまたはツ - ブス
- C 照射をそろえるためのもの、例、コリメ - タ、スリットまたはモノクロメ - タ
- G ・マルチホ - ル、グリッド
- M 製造方法、材質
- Z その他のもの
- 1/04 ・可変絞り、シャッタ - 、チョッパ - を用いるもの [2]
- R 照射範囲を限定するもの
- D ・井桁状のもの
- T ・3以上の自由度を有するもの
- P 強度を変えるためのもの
- S シャッタ - 、チョッパ -
- Z その他のもの
- 1/06 ・回折、屈折または反射を用いるもの、例、モノクロメ - タ - （G21K1/10、G21K7/00が優先）[2]
- A 回折、屈折または反射をさせるもの自体
- B ・回折、屈折または反射させるものの形状、構造に特徴のあるもの
- C ・材質に特徴のあるもの
- D ・製造方法に関するもの
- F モノクロメ - タ - 等、回折、屈折または反射をさせるものを組み込んだ装置
- G ・装置の構成、配置
- K ・可動部に特徴のあるもの
- L …ゴニオメ - タに関するもの
- M …ミラ - 部
- N …ミラ - の交換、切替、わん曲装置
- P …ミラ - に付属する装置、例、ホルダ -
- S …スリット部

- T …可動部、ミラ - 部、スリット部以外の細部、例、コリメ - タ -
- Z その他のもの
- 1/08 ・電氣的または磁氣的手段によるビ - ム偏向、集中または集束（電子管の電子光学装置 H01J29/46）[2]
- 1/087 ・電氣的手段によるもの [4]
- F ビ - ムの集束
- D ビ - ムの偏向
- S ビ - ムの走査
- Z その他のもの
- 1/093 ・磁氣的手段によるもの [4]
- F ビ - ムの集束
- D ビ - ムの偏向（G21K1/093 F 優先）
- S ビ - ムの走査
- Z その他のもの
- 1/10 ・散乱装置；吸収装置 [2]
- S 散乱装置
- A 吸収装置
- Z その他のもの
- 1/12 ・共鳴吸収体またはそのための駆動機構、例、メスバウワ - 効果装置 [3]
- 1/14 ・電荷交換装置を用いるもの、例、ビ - ムの電荷の中性化または極性を変えるためのもの [3]
- 1/16 ・分極化装置を用いるもの、例、分極したイオンビ - ムを得るためのもの [3]
- 3/00 電離放射線フィルタ - 、例、X線フィルタ - [2]
- E 特性補償〔例、イコライザ - 〕
- S スペクトル特性補償
- W 減衰〔例、ウェッジフィルタ - 〕
- M 製造方法、材質
- Y X線、線以外に使用
- Z その他のもの〔フィルタ - 切替え、取付け等、細部を含む〕
- 4/00 粒子または電離放射線の空間分布を可視像に変換するための変換スクリ - ン、例、螢光スクリ - ン [3]
- A 粒子または電離放射線の入射とほぼ同時に可視像情報〔例えば光〕を出力するもの；例、螢光スクリ - ン、増感紙
- B ・混入、或いは塗付される螢光体に特徴のあるもの〔螢光体そのものは C09K11/00〕
- C ・光以外の情報を出力するもの
- K スクリ - ンからの情報を取り出す為に、検出されるX線または粒子線とは別の刺激〔例えばレ - ザ - 光〕を加えるもの
- L ・レ - ザ - 光を照射するもの；例、放射線像変換パネル〔輝尽性螢光体を用いたもの、イメ - ジングプレート（IP）
- M ・螢光体に特徴のあるもの〔螢光体そのものは C09K11/00〕
- N ・構造、螢光体以外の混入物に特徴のあるもの
- Z その他のもの
- 5/00 照射装置（照射を容易にするための原子炉の適用 G21C23/00；照射のための放電管 H01J33/00、H01J37/00）[2]
- M 複数線種のためのもの〔主としてX線と電子線〕
- S 安全装置、防護装置

| | | |
|------|---|------------------------------------|
| | B | 照射室の雰囲気に関するもの |
| | W | 照射窓に特徴のあるもの〔膜の成分を含む〕 |
| | C | ・気体による照射窓の冷却〔フィルタ - の冷却を含む〕 |
| | D | ・気体以外による照射窓の冷却〔フィルタ - の冷却を含む〕 |
| | E | ・窓の交換に関するもの〔フィルタ - の交換を含む〕 |
| | R | 照準合わせ、視野、位置決め |
| | A | 付属装置〔制御、信号処理を含む〕 |
| | Z | その他のもの |
| 5/02 | | ・ビ - ム形成手段をもたないもの [2] |
| | X | X線照射装置 |
| | N | 中性子照射装置〔タ - ゲットによる発生照射装置を含む〕 |
| | R | RI線源による照射装置 |
| | A | ・アプリケ - タ - |
| | W | ・複数の放射線源を有するもの |
| | Z | その他のもの |
| 5/04 | | ・ビ - ム形成手段をもつもの [2] |
| | E | 電子線照射装置 |
| | M | ・電子顕微鏡、電子線露光装置、溶接装置に関するもの |
| | F | ・フィラメント、電極に関するもの |
| | A | イオンビ - ム照射装置〔イオン注入を含む〕 |
| | W | 複数の照射源を有するもの〔複数線種 H05H5/00〕 |
| | C | ビ - ム位置、ビ - ム電流の検出、制御に関するもの |
| | D | 加速器からの荷電粒子の取り出し |
| | S | 偏向、反射等によって被照射体全面を照射するもの |
| | Z | その他のもの |
| 5/08 | | ・照射されるタ - ゲットまたは物体の保持具 [2] |
| | A | 被照射体用の照射用カプセル、気送用カプセル |
| | B | 線源用の照射用カプセル、気送用カプセル |
| | C | タ - ゲットの冷却〔X線発生電極の冷却も含む〕 |
| | N | 中性子発生のためのもの〔H05H6/00も付与する〕 |
| | X | X線発生のためのもの〔照射装置は 5/02, 取扱いは 1/00〕 |
| | R | RI製造用〔主分類は G21G1/10〕 |
| | Z | その他のもの |
| 5/10 | | ・ビ - ム線源と被照射物体間に相対運動を生じるもの [3] |
| | C | コンベアによるもの |
| | T | 回転テ - ブルによるもの |
| | L | 被照射体が線状のもの |
| | S | 被照射体がシ - ト状、テ - プ状のもの〔主として塗膜硬化、乾燥〕 |
| | F | 被照射体が流動体のもの〔流体による移送を含む〕 |
| | M | 線源が移動するもの〔主として医療用〕 |
| | Z | その他のもの |
| 7/00 | | ガンマ線またはX線顕微鏡 [2] |